

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

3D-сканирующий лазерный микроскоп

OLS5000

LEXT

Скорость и точность

Новый уровень метрологии поверхности

НОВИНКА

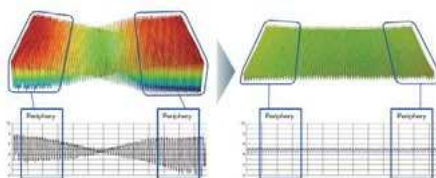


Непревзойденная скорость п

1

Захват поверхности любой формы

- **4K Технология сканирования 4K**
Сканирование с разрешением 4096 пикселей по оси X
Захват рельефных пиков с острым углом до 87.5°
- **Функция Smart Judge**
Сглаживание шумов без потери данных о тонкой топографии структуры
- **Специализированные объективы для LEXT**
Равномерное измерение по всему полю зрения объектива



2

Быстрее в 4 раза

- **PEAK Алгоритм**
Повышает точность и скорость при построении 3D моделей поверхностей на малых и больших увеличениях
- **Алгоритм Skip Scan**
Экономия времени при сканировании вертикальных перепадов высот



3

Интуитивный интерфейс

- **Функция Smart Scan**
Проведение полного цикла сканирования и измерения одним нажатием кнопки
- **Функция Easy Analysis**
Выделение области на модели поверхности
формирование всеобъемлющего отчета
одним нажатием кнопки
- **Создание шаблонов отчетов**
Система запоминает шаги при создании отчета и создает шаблон, который будет выполнен в автоматическом режиме во время следующего сканирования

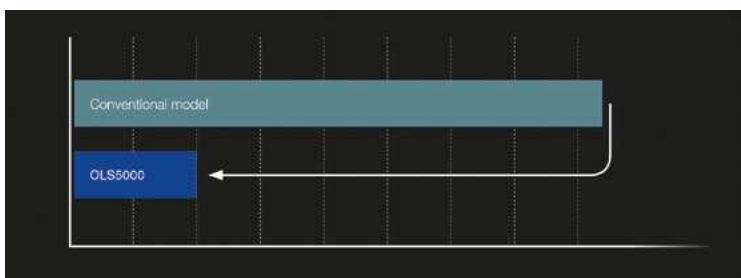
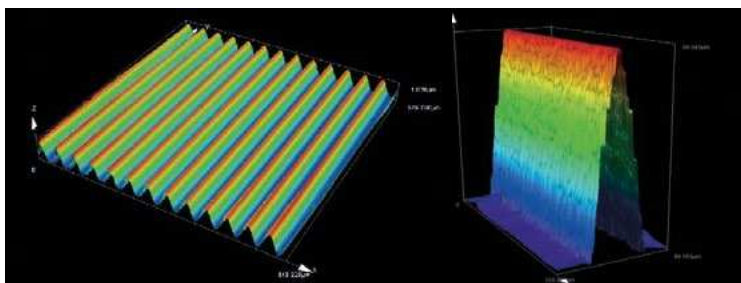
4

Измерение нестандартных образцов

- **Увеличенная рама**
Возможность изучать образцы высотой до 210 мм
- **Измерение углубленных поверхностей**
Специальные объективы для LEXT с увеличенной рабочей дистанцией
- **Объективы со сверхбольшой рабочей дистанцией**
Измерение поверхности в углублениях на деталях до 25 мм



получения достоверных данных



Непревзойденная скорость получения достоверных данных

Спецификация

Модель		OLS5000-SAF	OLS5000-SMF	OLS5000-LAF	OLS5000-EAF	OLS5000-EMF
Суммарное увеличение		54x - 17,280x				
Поле зрения		16 мкм - 5,120 мкм				
Скорость передачи данных (лазер) [FPS]		3.25 - 55.6				
Скорость передачи данных (цвет) [FPS]		30				
Принцип измерений	Оптическая система	Лазерная конфокальная система, отраженный свет, светлое поле лазерный/цветной дифференциально-интерференционный контраст (DIC)				
	Светочувствительный элемент	Лазерная конфокальная система: 2-канальный фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) Цветная система: CMOS цветная камера				
Измерение высоты	Разрешение при построении модели	6 нм				
	Линейная шкала	0.78 нм				
	Динамический диапазон	16 б ит				
	Повторяемость	20X 0.03 мкм, 50X 0.012 мкм, 100X 0.012 мкм				
	Точность	Измеряемая величина +/- 1.5%				
	Точность сшитых изображений	20X 15+0.5L мкм, 50X 9+0.5L мкм, 100X 7+0.5L мкм (L: длина шивки[мкм])				
	Шум измерения (Sqnoise)	1 нм				
Измерения по X-Y	Разрешение при построении модели	120 нм				
	Повторяемость 3σ-1	20X 0.05 мкм, 50X 0.04 мкм, 100X 0.02 мкм				
	Точность	Измеряемая величина +/- 1.5%				
	Точность сшитых изображений	20X 15+0.5L мкм, 50X 9+0.5L мкм, 100X 7+0.5L мкм (L: длина шивки[мкм])				
Максимальное количество точек данных в одном измерении		4096 x 4096 пикс				
Максимальное количество точек данных		36 МП				
Лазерный источник	Длина волны	405 нм				
	Максимальная энергия лазера	0.95 мВт				
	Класс лазера	Класс 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014)				
Цветной источник света		Белый светодиод				
XY столик	Линейные измерения сшитых изображений	.	нет	нет	.	нет
	Диапазон перемещения	100 x 100 мм Моторизованный	100 x 100 мм Ручной	302 x 302 мм Моторизованный	100 x 100 мм Моторизованный	100 x 100 мм Ручной
Максимальная высота образца		100 мм	30 мм	37 мм	210 мм	140 мм
Мощность		240 Вт	240 Вт	278 Вт	240 Вт	240 Вт
Вес	Микроскоп	~ 30 кг	~ 30 кг	~ 50 кг	~ 43 кг	~ 39 кг
	Контроллер	~ 12 кг				

Объективы, скорректированные для работы с лазером λ=405 нм

Серия	Модель	Числовая апертура	Рабочая дистанция (WD)(мм)	Серия	Модель	Числовая апертура	Рабочая дистанция (WD)(мм)
UIS2 объективы	MPLFLN2.5x	0.08	10.7	Объективы со сверхбольшой рабочей дистанцией	SLMPLN20x	0.25	25
	MPLFLN5x	0.15	20		SLMPLN50x	0.35	18
Специальный объектив LEXT	MPLFLN10xLEXT	0.3	10.4		SLMPLN100x	0.6	7.6
Специальные объективы LEXT (высокого разрешения)	MPLAPON20xLEXT	0.6	1	Объективы с большой рабочей дистанцией для LCD экранов	LCPLFLN20xLCD	0.45	7.4-8.3
	MPLAPON50xLEXT	0.95	0.35		LCPLFLN50xLCD	0.7	3.0-2.2
	MPLAPON100xLEXT	0.95	0.35		LCPLFLN100xLCD	0.85	1.0-0.9
Специальные объективы LEXT с большой рабочей дистанцией	LMPLFLN20xLEXT	0.45	6.5				
	LMPLFLN50xLEXT	0.6	5				
	LMPLFLN100xLEXT	0.8	3.4				



117342, Москва,
ул. Обручева, д.34/63, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 781-07-85
info@melytec.ru

192029, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 3, лит. А, оф. 615
Тел./факс: +7 (812) 380-84-85
infospb@melytec.ru

620075, Екатеринбург,
ул. Тургенева, д. 18, оф. 701
Тел./факс: +7 (343) 287-12-85
infoural@melytec.ru

03067, Киев, бульвар Лепсе,
д. 4, корпус № 1, оф. 308
Тел.: +38 (044) 454-05-90
Факс: +38 (044) 454-05-95
infoua@melytec.ru

www.melytec.ru

YouTube [melytec](https://www.youtube.com/melytec)



Дата верстки: 20.02.2018 г. Подписано в печать: 20.02.2018 г.